(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-23213

(P2001-23213A)

(43)公開日 平成13年1月26日(2001.1.26)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テ	₹Jト*(参考)
G11B	7/095		G11B	7/095	G	5D109
					В	5D118
	7/135			7/135	Z	5 D 1 1 9
	19/20			19/20	E	

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 13 頁)

(21)出願番号	特爾平11-197058

(22)出願日 平成11年7月12日(1999.7.12) (71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 柏原 芳郎

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

Fターム(参考) 5D109 DA08 DA15

5D118 AA13 AA21 BA01 BB02 BF02

BF03 CA11 CD02 CD04 CD13

5D119 AA04 AA12 AA21 BA01 DA01

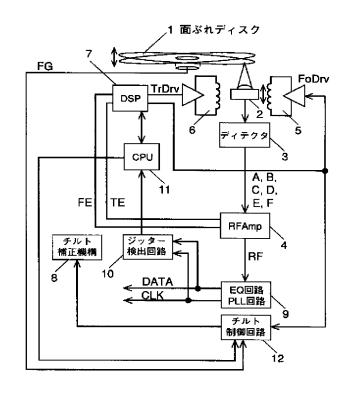
DA05 EA03 JA09 JA62

(54) 【発明の名称】 チルト制御方法及び光ディスク装置

(57)【要約】

【課題】 光ディスクの面振れにより発生するスキュー を適切にチルト補正し、ジッターの発生を抑えて安定し たデータ読出しを行えるチルト制御方法及び光ディスク 装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 光ディスク1の面振れによるチルト量変 化と一対一に対応して変化するフォーカス制御信号をチ ルト制御回路12に入力し、チルト制御回路12でフォ ーカス制御信号を基にチルト補正機構8の作動制御を行 うことで、チルト量に対応した補正を確実に行え、チル トを解消もしくはチルトの影響を回避でき、面振れを有 する光ディスク1に対してもジッターの発生を抑えて安 定してデータ読出しを行える。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】光ディスクを回転させるスピンドルモータ と、光ディスクにレーザ光を照射すると共に光ディスク からのレーザ反射光を受光する光ピックアップと、前記 光ディスクで反射された光信号を電気信号に変換するデ ィテクタと、光ディスク信号面に対して常にレーザ光の 焦点が合うよう光ピックアップをフォーカス方向に駆動 するフォーカスアクチュエータと、光ディスクのスパイ ラル状又は同心円状のトラックに対して常にレーザ光が 追従するよう光ピックアップをトラッキング方向に駆動 するトラッキングアクチュエータと、前記ディテクタか ら出力される信号を基に、前記フォーカスアクチュエー タに対するフォーカス制御及び前記トラッキングアクチ ュエータに対するトラッキング制御の各サーボ制御を行 うサーボプロセッサと、チルト発生時における光ディス クからのレーザ反射光の前記光ピックアップにおけるず れを補正するチルト補正機構と、当該チルト補正機構の 作動制御を行うチルト制御部と、前記ディテクタで変換 された電気信号のうち光ディスク読出し用の信号を基に 生成されたデータ信号及び同期クロックからジッターを 検出するジッター検出手段とを備える光ディスク装置の チルト制御方法であって、前記サーボプロセッサからフ ォーカスアクチュエータに対して出力されるフォーカス 制御信号がチルト制御部にも入力され、当該チルト制御 部が、光ディスク形状により生じるチルト量に対応して 変化するフォーカス制御信号に基づいたチルト調整を前 記チルト補正機構に行わせることを特徴とするチルト制 御方法。

【請求項2】請求項1に記載のチルト制御方法において、前記チルト制御部が、入力されたフォーカス制御信号を出力調整して得られた信号をチルト補正機構に対しラジアル方向のチルト調整用の制御信号として出力すると共に、前記フォーカス制御信号を出力調整し且つ光ディスクの回転位置に対し位相を90°ずらして得られた信号をチルト補正機構に対しタンジェンシャル方向のチルト調整用の制御信号として出力し、チルト補正機構にそれぞれラジアル方向、タンジェンシャル方向のチルト調整を行わせることを特徴とするチルト制御方法。

【請求項3】請求項2に記載のチルト制御方法において、前記フォーカスアクチュエータが、フォーカス方向への駆動機構を少なくとも三つ以上有してチルト補正機構を兼ね、前記チルト制御部から出力されるラジアル方向のチルト調整用の制御信号又はタンジェンシャル方向のチルト調整用の制御信号をそれぞれ所定の前記駆動機構にフォーカス制御信号と合わせて入力し、前記各駆動機構の発生駆動力を異ならせ、前記光ピックアップをラジアル方向及びタンジェンシャル方向にそれぞれ傾動させて光ピックアップと光ディスクとの平行度を補正することを特徴とするチルト制御方法。

【請求項4】請求項2に記載のチルト制御方法におい

50

2

て、前記スピンドルモータをラジアル方向に傾動可能な ラジアルチルト補正機構、及び、前記スピンドルモータ をタンジェンシャル方向に傾動可能なタンジェンシャル チルト補正機構をそれぞれ前記チルト補正機構として備 え、前記チルト制御部から出力されるラジアル方向のチ ルト調整用の制御信号を前記ラジアルチルト補正機構 に、タンジェンシャル方向のチルト調整用の制御信号を 前記タンジェンシャルチルト補正機構にそれぞれ入力 し、ラジアルチルト補正機構及びタンジェンシャルチル ト補正機構をそれぞれ駆動し、前記スピンドルモータを ラジアル方向及びタンジェンシャル方向にそれぞれ傾動 させて光ピックアップと光ディスクとの平行度を補正す ることを特徴とするチルト制御方法。

【請求項5】請求項2に記載のチルト制御方法におい て、前記光ピックアップを光ディスクの半径方向に案内 する二本の平行なシャフトと、当該シャフトのうち一方 のシャフトの一端部に係合させて配設され、当該シャフ ト一端部を移動させて前記光ピックアップをラジアル方 向に傾動させるラジアルチルト補正機構と、他方のシャ フトの少なくとも一端部に係合させて配設され、前記他 方のシャフトを移動させて前記光ピックアップをタンジ ェンシャル方向に傾動させるタンジェンシャル方向補正 機構とを前記チルト補正機構として備え、前記チルト制 御部から出力されるラジアル方向のチルト調整用の制御 信号を前記ラジアルチルト補正機構に、タンジェンシャ ル方向のチルト調整用の制御信号を前記タンジェンシャ ルチルト補正機構にそれぞれ入力し、ラジアルチルト補 正機構及びタンジェンシャルチルト補正機構をそれぞれ 駆動し、前記光ピックアップをラジアル方向及びタンジ ェンシャル方向にそれぞれ傾動させて光ピックアップと 光ディスクとの平行度を補正することを特徴とするチル **ト制御方法**。

【請求項6】請求項2に記載のチルト制御方法において、前記光ピックアップにおける光ディスクからのレーザ反射光が通る経路中に配設され、区分された複数のシャッター領域ごとに電圧印加で透過光量を調節してレーザ反射光を補正する液晶シャッター部を前記チルト補正機構として備え、前記チルト制御部から出力されるラジアル方向のチルト調整用の制御信号をラジアル方向のチルトに伴ってレーザ反射光がずれ込む所定の前記シャッター領域に、且つタンジェンシャル方向のチルトに伴ってレーザ反射光がずれ込む前記と別の所定シャッター領域にそれぞれ入力し、各シャッター領域での透過光量を調節して、ラジアル方向及びタンジェンシャル方向へのチルトに伴うレーザ反射光のずれを補正することを特徴とするチルト制御方法。

【請求項7】請求項1ないし6のいずれかに記載のチルト制御方法を用いることを特徴とする光ディスク装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスク装置で のCD及びDVD等の光ディスク再生において、面ぶれ を伴う光ディスクの安定した再生を行えるチルト制御方 法及びこれを用いた光ディスク装置に関するものであ る。

3

[0002]

【従来の技術】光ディスク装置において、チルト(光ピ ックアップから照射されるレーザ光に対する光ディスク 内の信号記録面の傾き)によって発生する再生信号のジ 10 ッターは、光ディスクの記録密度が増大するにつれて悪 化し、機構部品取付けの誤差で生じるチルトがジッター に及す影響もより一層大きくなる。このため、従来か ら、光ディスク装置においては、機構部品取付けで生じ るチルトを解消する光ピックアップのチルト補正機構が 用いられていた。こうした従来のチルト補正機構の一例 として、光ピックアップの案内用シャフトの向きを調整 して光ピックアップのあおり調整を行う仕組みを図15 に示す。図15は従来の光ディスク装置の構成図であ る。

【0003】図15において、従来の光ディスク装置の チルト補正機構は、光ディスク(図示を省略)にレーザ 光を照射する光ピックアップ2と、光ピックアップ2を 光ディスクの半径方向に案内する二つのシャフト25、 26と、一方のシャフト25端部に配設され、光ピック アップ2のレーザ光軸の光ディスク半径方向における傾 き調整を行うラジアルチルト調整ねじ23と、他方のシ ャフト26端部に配設され、レーザ光軸の光ディスク接 線方向における傾き調整を行うタンジェンシャルチルト 調整ねじ24とを備える構成である。

【0004】上述の光ディスク装置では、二つの調整ね じ23、24で二つのシャフト25、26端部を昇降さ せて、光ピックアップ2のあおり調整(チルト調整)を 行う仕組みである。光ピックアップ2から照射されるレ ーザ光軸における光ディスク半径方向の傾き調整をラジ アルチルト調整ねじ23で、光ディスク接線方向の傾き 調整をタンジェンシャルチルト調整ねじ24でそれぞれ 調整することにより、チルトを抑え、再生信号のジッタ 一が最小となるようにしている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】従来の光ディスク装置 は上記のように構成されており、光ピックアップ2のあ おり調整(チルト調整)を行うことで機構部品取付けの 誤差によるスキュー発生を抑えることができるものの、 光ディスク自体が許容範囲を超える面振れ(光ディスク 回転方向における変形)を有する場合には、光ディスク 再生時に光ディスクの所定のレーザ光被照射位置でスキ ューが発生し、且つ光ディスクの回転でスキュー量が大 きく変化する状態となり、従来の調整機構では補正でき

くなるという問題点を有していた。

【0006】本発明は上記問題点を解決するためになさ れたもので、光ディスクの面振れにより発生するチルト を適切に補正し、ジッターの発生を抑えて安定したデー 夕読出しを行えるチルト制御方法及びこれを用いた光デ ィスク装置を提供することを目的とする。

【0007】

(3)

20

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明のチルト制御方法は、光ディスクを回転させ るスピンドルモータと、光ディスクにレーザ光を照射す ると共に光ディスクからのレーザ反射光を受光する光ピ ックアップと、光ディスクで反射された光信号を電気信 号に変換するディテクタと、光ディスク信号面に対して 常にレーザ光の焦点が合うよう光ピックアップをフォー カス方向に駆動するフォーカスアクチュエータと、光デ ィスクのスパイラル状又は同心円状のトラックに対して 常にレーザ光が追従するよう光ピックアップをトラッキ ング方向に駆動するトラッキングアクチュエータと、デ ィテクタから出力される信号を基に、フォーカスアクチ ュエータに対するフォーカス制御及びトラッキングアク チュエータに対するトラッキング制御の各サーボ制御を 行うサーボプロセッサと、チルト発生時における光ディ スクからのレーザ反射光の光ピックアップにおけるずれ を補正するチルト補正機構と、当該チルト補正機構の作 動制御を行うチルト制御部と、ディテクタで変換された 電気信号のうち光ディスク読出し用の信号を基に生成さ れたデータ信号及び同期クロックからジッターを検出す るジッター検出手段とを備える光ディスク装置のチルト 制御方法であって、サーボプロセッサからフォーカスア クチュエータに対して出力されるフォーカス制御信号が チルト制御部にも入力され、当該チルト制御部が、光デ ィスク形状により生じるチルト量に対応して変化するフ ォーカス制御信号に基づいたチルト調整をチルト補正機 構に行わせるものである。

【0008】これにより、光ディスクの面振れにより光 ディスクのラジアル方向又はタンジェンシャル方向のチ ルトが発生して光ディスクからのレーザ反射光の光軸が 傾いてずれている場合でも、光ピックアップでのレーザ 反射光の受光状態を改善して、ジッターの発生を抑えて 安定したデータ読出しを行える光ディスク装置が得られ る。

[0009]

40

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明 は、光ディスクを回転させるスピンドルモータと、光デ ィスクにレーザ光を照射すると共に光ディスクからのレ ーザ反射光を受光する光ピックアップと、光ディスクで 反射された光信号を電気信号に変換するディテクタと、 光ディスク信号面に対して常にレーザ光の焦点が合うよ う光ピックアップをフォーカス方向に駆動するフォーカ ず、ジッターが増大して光ディスクを正しく再生できな「50「スアクチュエータと、光ディスクのスパイラル状又は同 心円状のトラックに対して常にレーザ光が追従するよう 光ピックアップをトラッキング方向に駆動するトラッキ ングアクチュエータと、ディテクタから出力される信号 を基に、フォーカスアクチュエータに対するフォーカス 制御及びトラッキングアクチュエータに対するトラッキ ング制御の各サーボ制御を行うサーボプロセッサと、チ ルト発生時における光ディスクからのレーザ反射光の光 ピックアップにおけるずれを補正するチルト補正機構 と、当該チルト補正機構の作動制御を行うチルト制御部 と、ディテクタで変換された電気信号のうち光ディスク 10 読出し用の信号を基に生成されたデータ信号及び同期ク ロックからジッターを検出するジッター検出手段とを備 える光ディスク装置のチルト制御方法であって、サーボ プロセッサからフォーカスアクチュエータに対して出力 されるフォーカス制御信号がチルト制御部にも入力さ れ、当該チルト制御部が、光ディスク形状により生じる チルト量に対応して変化するフォーカス制御信号に基づ いたチルト調整をチルト補正機構に行わせることを特徴 とするチルト制御方法であり、光ディスクの面振れによ り光ディスクのラジアル方向及びタンジェンシャル方向 のチルトが周期的に発生して光ディスクからの反射光の 光軸が傾いてずれる場合でも、面振れに伴うフォーカス 制御信号変化と面振れによるチルト量変化とは一対一に 対応していることから、フォーカス制御信号をチルト制 御部に入力することで確実にチルト量に応じたチルト補 正機構の作動制御が行え、チルトを解消もしくはチルト の影響を回避して、ジッターの発生を抑えて安定してデ ータ読出しを行えるという作用を有する。

【0010】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載 のチルト制御方法において、チルト制御部が、入力され 30 たフォーカス制御信号を出力調整して得られた信号をチ ルト補正機構に対しラジアル方向のチルト調整用の制御 信号として出力すると共に、フォーカス制御信号を出力 調整し且つ光ディスクの回転位置に対し位相を90°ず らして得られた信号をチルト補正機構に対しタンジェン シャル方向のチルト調整用の制御信号として出力し、チ ルト補正機構にそれぞれラジアル方向、タンジェンシャ ル方向のチルト調整を行わせることを特徴とするチルト 制御方法であり、位相が90°ずれた関係となっている ラジアル方向のチルト量変化とタンジェンシャル方向の チルト量変化に対して、これらと一対一に対応するフォ ーカス制御信号とこのフォーカス制御信号の位相を90 ずらした信号とに基づいて、チルト補正機構でラジア ル方向及びタンジェンシャル方向のそれぞれのチルトを 確実に補正でき、面振れを有する光ディスクについても 安定してデータ読出しを行えるという作用を有する。

【0011】請求項3に記載の発明は、請求項2に記載のチルト制御方法において、フォーカスアクチュエータが、フォーカス方向への駆動機構を少なくとも三つ以上有してチルト補正機構を兼ね、チルト制御部から出力さ

れるラジアル方向のチルト調整用の制御信号又はタンジェンシャル方向のチルト調整用の制御信号をそれぞれ所定の駆動機構にフォーカス制御信号と合わせて入力し、各駆動機構の発生駆動力を異ならせ、光ピックアップをラジアル方向及びタンジェンシャル方向にそれぞれ傾動させて光ピックアップと光ディスクとの平行度を補正することを特徴とするチルト制御方法であり、ラジアル方向のチルト量変化とタンジェンシャル方向のチルト量変化に対応させてチルト制御部から出力するフォーカス方向のチルト調整用制御信号とタンジェンシャル方向のチルト調整用制御信号で、チルト補正機構としてのフォーカスアクチュエータの複数の駆動機構を各々制御して光ピックアップをチルトが解消する状態に傾動させられ、面振れを有する光ディスクについても安定してデータ読出しを行えるという作用を有する。

6

【0012】請求項4に記載の発明は、請求項2に記載 のチルト制御方法において、スピンドルモータをラジア ル方向に傾動可能なラジアルチルト補正機構、及び、ス ピンドルモータをタンジェンシャル方向に傾動可能なタ ンジェンシャルチルト補正機構をそれぞれチルト補正機 構として備え、チルト制御部から出力されるラジアル方 向のチルト調整用の制御信号をラジアルチルト補正機構 に、タンジェンシャル方向のチルト調整用の制御信号を タンジェンシャルチルト補正機構にそれぞれ入力し、ラ ジアルチルト補正機構及びタンジェンシャルチルト補正 機構をそれぞれ駆動し、スピンドルモータをラジアル方 向及びタンジェンシャル方向にそれぞれ傾動させて光ピ ックアップと光ディスクとの平行度を補正することを特 徴とするチルト制御方法であり、ラジアル方向のチルト 量変化とタンジェンシャル方向のチルト量変化に対し、 これらに対応させてチルト制御部から出力するフォーカ ス方向のチルト調整用制御信号とタンジェンシャル方向 のチルト調整用制御信号で、チルト補正機構としてのラ ジアルチルト補正機構及びタンジェンシャルチルト補正 機構をそれぞれ制御してスピンドルモータ並びに光ディ スクをチルトが解消する状態に傾動させられ、面振れを 有する光ディスクについても安定してデータ読出しを行 えるという作用を有する。

【0013】請求項5に記載の発明は、請求項2に記載のチルト制御方法において、光ピックアップを光ディスクの半径方向に案内する二本の平行なシャフトと、当該シャフトのうち一方のシャフトの一端部に係合させて配設され、当該シャフト一端部を移動させて光ピックアップをラジアル方向に傾動させるラジアルチルト補正機構と、他方のシャフトの少なくとも一端部に係合させて配設され、他方のシャフトを移動させて光ピックアップをタンジェンシャル方向に傾動させるタンジェンシャル方向補正機構とをチルト補正機構として備え、チルト制御部から出力されるラジアル方向のチルト調整用の制御信号をラジアルチルト補正機構に、タンジェンシャル方向

のチルト調整用の制御信号をタンジェンシャルチルト補 正機構にそれぞれ入力し、ラジアルチルト補正機構及び タンジェンシャルチルト補正機構をそれぞれ駆動し、光 ピックアップをラジアル方向及びタンジェンシャル方向 にそれぞれ傾動させて光ピックアップと光ディスクとの 平行度を補正することを特徴とするチルト制御方法であ り、ラジアル方向のチルト量変化とタンジェンシャル方 向のチルト量変化に対し、これらに対応させてチルト制 御部から出力するフォーカス方向のチルト調整用制御信 号とタンジェンシャル方向のチルト調整用制御信号で、 チルト補正機構としてのラジアルチルト補正機構及びタ ンジェンシャルチルト補正機構をそれぞれ制御して光ピ ックアップをチルトが解消する状態に傾動させられ、面 振れを有する光ディスクについても安定してデータ読出 しを行えるという作用を有する。

【0014】請求項6に記載の発明は、請求項2に記載 のチルト制御方法において、光ピックアップにおける光 ディスクからのレーザ反射光が通る経路中に配設され、 区分された複数のシャッター領域ごとに電圧印加で透過 光量を調節してレーザ反射光を補正する液晶シャッター 部をチルト補正機構として備え、チルト制御部から出力 されるラジアル方向のチルト調整用の制御信号をラジア ル方向のチルトに伴ってレーザ反射光がずれ込む所定の シャッター領域に、且つタンジェンシャル方向のチルト 調整用の制御信号をタンジェンシャル方向のチルトに伴 ってレーザ反射光がずれ込むと別の所定シャッター領域 にそれぞれ入力し、各シャッター領域での透過光量を調 節して、ラジアル方向及びタンジェンシャル方向へのチ ルトに伴うレーザ反射光のずれを補正することを特徴と するチルト制御方法であり、ラジアル方向のチルト量変 30 化とタンジェンシャル方向のチルト量変化に対し、これ らに対応させてチルト制御部から出力するフォーカス方 向のチルト調整用制御信号とタンジェンシャル方向のチ ルト調整用制御信号で、チルト補正機構としての液晶シ ャッター部の複数のシャッター領域をそれぞれ制御して チルトに伴うレーザ反射光のずれを補正し、ディテクタ で反射光を正しく電気信号に変換することができ、面振 れを有する光ディスクについても安定してデータ読出し を行えるという作用を有する。

【0015】請求項7に記載の発明は、請求項1ないし6のいずれかに記載のチルト制御方法を用いることを特徴とする光ディスク装置であり、光ディスクの面振れにより光ディスクのラジアル方向及びタンジェンシャル方向のチルトが周期的に発生して光ディスクからの反射光の光軸が傾いてずれる場合でも、面振れに伴うフォーカス制御信号変化と面振れによるチルト量変化とは一対一に対応していることから、フォーカス制御信号をチルト制御部に入力することで確実にチルト量に応じたチルト補正機構の作動制御が行え、チルトを解消もしくはチルトの影響を回避して、ジッターの発生を抑えて安定して

データ読出しを行えるという作用を有する。

【0016】以下、本発明の実施の形態について、図1 ~図14を参照しながら説明する。

【0017】(実施の形態1)図1は本発明の実施の形 熊1における光ディスク装置のブロック図である。図1 において、本実施の形態に係る光ディスク装置は、光デ ィスク1にレーザ光を照射すると共に光ディスク1で反 射された光を受光する光ピックアップ2と、この光ピッ クアップ2で得た光ディスク1からの反射光を電流に変 換し、光ディスク1からのデータ読出し用並びにフォー カスエラー検出用の出力信号であるA信号、B信号、C 信号、及びD信号と、トラッキングエラー検出用の出力 信号であるE信号及びF信号の各電気信号を出力するデ ィテクタ3と、このディテクタ3から出力されるA信号 及びC信号を加算した信号とB信号及びD信号を加算し た信号との差信号であるフォーカスエラー信号(以下、 FE信号と略称)を生成し、且つ、ディテクタ3から出 力されるE信号及びF信号から差信号であるトラッキン グエラー信号(以下、TE信号と略称)を生成すると共 に、ディテクタ3より出力されるA信号、B信号、C信 号、D信号を加算し、RF信号を生成するRFアンプ4 と、光ピックアップ2をフォーカス方向に駆動するフォ ーカスアクチュエータ5と、光ピックアップ2をトラッ キング方向に駆動するトラッキングアクチュエータ6 と、RFアンプ4からTE信号及びFE信号を入力さ れ、FE信号を基に光ディスク1信号面に常にレーザ光 の焦点が合うようにフォーカスアクチュエータ5の制御 を行うと共に、TE信号を基に光ディスク1のスパイラ ル状又は同心円状のトラックに対してレーザ光が常に追 従するようにトラッキングアクチュエータ6の制御を行 うサーボプロセッサ7と、光ディスク1と光ピックアッ プ2との間に生じるチルトを補正するチルト補正機構8 と、RF信号の波形整形を行い、RFの二値化信号(図 1中でDATAと表現)、及び、同期クロック(図1中 でCLKと表現)を生成するイコライザ及びPLL回路 (EQ/PLL回路) 9と、二値化信号と同期クロック からジッターを検出するジッター検出回路10と、ジッ ター検出回路10からジッターの検出状態を入力され、 サーボプロセッサ7を制御するCPU11と、チルト補 正機構8の駆動制御を行うチルト制御部としてのチルト 制御回路12とを備える構成である。

【0018】チルト制御回路12は、フォーカスアクチュエータ5に対してサーボプロセッサ7から出力されるフォーカス制御信号を入力され、このフォーカス制御信号を出力調整してチルト補正機構8に出力し、光ディスク1の回転方向におけるチルト変化に対応してチルト調整を行うものである。

制御部に入力することで確実にチルト量に応じたチルト 【0019】ここで、図2は図1の光ディスク装置のラ 補正機構の作動制御が行え、チルトを解消もしくはチル ジアル方向チルト発生概念説明図である。図2におい トの影響を回避して、ジッターの発生を抑えて安定して 50 て、面ぶれを有する光ディスクにおけるラジアル方向チ

8

1.0

ルト発生概念を説明する。図2に示すように、面ぶれの 最上位点においては、光ピックアップ2のフォーカス位 置が最上位部に位置すると共に、最大チルト量が発生す る。また、光ディスク1と光ピックアップ2が平行とな った時には、フォーカス位置は基準位置となると共に、 チルト量がOとなる。面ぶれの最下位点においては、フ ォーカス位置が最下位部に位置すると共に、最大チルト 量が発生する。

【0020】また、図3は図1の光ディスク装置のタン ジェンシャル方向チルト発生概念説明図である。図3に 10 おいて、面ぶれを有する光ディスクにおけるタンジェン シャル方向チルト発生概念を説明する。図3に示すよう に、面ぶれの最上位点においては、光ピックアップ2の フォーカス位置が最上位部に位置すると共に、チルト量 が0となる。また、光ディスク1と光ピックアップ2が 平行となった時には、フォーカス位置は基準位置となる と共に、最大チルト量が発生する。また、最下位点にお いては、フォーカス位置が最下位部に位置すると共に、 チルト量は0となる。

【0021】以上のように、面ぶれを有する光ディスク の回転においては、面ぶれによってチルト量が変化する と共に、光ディスク1の回転によるフォーカス位置変 化、すなわち、光ディスク面位置に光ピックアップ2を 追随させるフォーカス制御におけるフォーカス制御信号 の変化が、チルト量の変化と一対一に対応する関係を有 している。

【0022】このことから、図1に示すように、フォー カス制御信号(図1中でFoDrvと表現)をチルト制 御回路12へ入力し、フォーカス制御信号に基づいてチ ルト補正機構8を制御することで、回転によるチルト量 30 変化に同期してチルトによる影響をキャンセルすること ができ、面ぶれを有する光ディスクに対して、安定した データ再生を行うことが可能となる。

【0023】(実施の形態2)本発明の実施の形態2に 係る光ディスク装置について図4及び図5に基づいて説 明する。図4は本発明の実施の形態2におけるチルト制 御ブロック図、図5は図4のチルト角とチルト制御信号 の関係説明図である。

【0024】本実施の形態2に係る光ディスク装置は、 実施の形態1と同様の構成におけるチルト制御回路12 として、図4に示すように、フォーカス制御信号(図4 中でFoDrvと表現)の振幅を常に一定とするための オートゲインコントロール回路(以下、AGCと略称) 13と、AGC13より出力される信号をディジタル値 に変換するA/D変換回路14と、A/D変換回路14 から出力されるディジタル値をアナログ値へ変換するた めのD/A変換回路15と、D/A変換回路15から出 力される値をCPU11の制御により任意のゲインで出 力することが可能なバッファ回路16と、A/D変換回 路14から出力されるデータをスピンドルモータ(図示 50 を省略)の回転パルスによりシフトさせ、回転周期に対 して位相を90°ずらしたデータを出力するためのシフ トレジスタ17と、シフトレジスタ17から出力される ディジタル値をアナログ値へ変換するためのD/A変換 回路18と、D/A変換回路18から出力される値をC PU11の制御により任意のゲインで出力することが可 能なバッファ回路19とを備える構成である。

【0025】チルト制御回路の動作に関して、図5に基 づいて説明する。図5で示すように、ラジアルチルト角 と、タンジェンシャルチルト角とは、90°ずれた位相 関係となっている。また、フォーカス制御信号は、内周 及び外周で周期は同じになるものの、振幅の異なる信号 となるために、この信号をそのままチルト補正機構8で 使用することはできない。従って、まず、フォーカス制 御信号に対し、AGC13を使用して、常に同じ振幅の 信号となるように制御する。また、タンジェンシャルチ ルト角の補正には、フォーカス制御信号に対して位相が 90° ずれた信号を生成する必要がある。このため、A GC13から出力された信号に対しA/D変換回路14 でA/D変換を行ってディジタルデータとしてデータ生 成を行うと共に、スピンドルモータの回転パルスを参照 しつつシフトレジスタ17でデータをシフトさせてい き、90° ずれた位相のディジタルデータを生成する。 【0026】次に、ディジタルデータをD/A変換回路 15で、また位相が90°ずれたディジタルデータをD /A変換回路18でそれぞれアナログ値へ戻し、位相が 90° ずれた二つの信号を生成する。上記方式を使用す ることで、光ディスク1の回転速度に依存せず、常に位 相の90°ずれた信号を生成することが可能である。

【0027】生成された各信号を、任意のゲインで出力 可能なバッファ回路16、19に入力することにより、 ラジアルチルト制御信号(RtDRV)と、タンジェン シャルチルト制御信号(TtDRV)とが得られる。こ れらの信号で、図1に示すチルト補正機構8を制御する こととなる。

【0028】このように、本実施の形態2に示すチルト 制御方法を備える光ディスク装置によって、ラジアルチ ルト制御信号及びタンジェンシャルチルト制御信号に基 づき、チルト補正機構8でラジアル方向及びタンジェン シャル方向のそれぞれのチルトを確実に補正でき、面ぶ れを有する光ディスクに対して、安定したデータ再生を 行うことが可能となる。

【0029】(実施の形態3)本発明の実施の形態3に 係る光ディスク装置について図6ないし図9に基づいて 説明する。

【0030】本実施の形態3に係る光ディスク装置は、 実施の形態2におけるチルト制御回路12により制御す るチルト補正機構として、多軸可動型のフォーカスアク チュエータ5を用いるものである。

【0031】図6は本発明の実施の形態3におけるフォ

ーカスアクチュエータの構成図、図7は図6のアクチュエータの駆動ブロック図である。図6に示すように、フォーカスアクチュエータ5のフォーカスコイルが、コイルA、コイルB、コイルC、コイルDの4つに分割されており、各コイルに流す電流を異ならせることにより、フォーカス制御に加えて、ラジアル方向及びタンジェンシャル方向の各チルト調整を可能とし、チルト補正機構8となる仕組みである。

【0032】また、図7に示すように、このチルト補正機構は、フォーカス制御信号(FoDRV)を全てのコ 10 イルへ入力し、フォーカス方向の駆動力を発生させる一方、チルト制御回路12から出力されるラジアルチルト制御信号(RtDRV)をコイルA及びコイルBへの入力信号に加算し、且つ、タンジェンシャルチルト制御信号(TtDRV)をコイルA及びコイルDへの入力信号に加算することによって、各コイルにおけるフォーカス方向の駆動力を異ならせ、光ピックアップ2主要部をラジアル方向及びタンジェンシャル方向に傾動させるものである。

【0033】ここで、本実施の形態3におけるチルト補正機構に対するチルト制御回路でのラジアルチルト制御信号のゲイン調整方法を、図8のフローチャートを使用して説明する。図8は図7のラジアルチルト制御のゲイン調整フローチャートである。前提として、ラジアルチルト制御の検索開始設定値をStartRtGain、最終設定値をEndRtGain、ステップを α 、ゲイン設定レジスタをRtGain、その設定におけるジッター値をjit (RtGain)、最良ジッター格納用変数としてBestIt、最良ジッターにおけるゲイン設定格納用変数としてIBestIt になったの設定にありるが

【0034】まず、初期化として、Bestjitに最大値(FFFFh)を入力し、BestRtGainをクリア(0h)し、RtGainにStartRtGainを設定する(Step1)。次に、RtGainにおけるジッター値jit(RtGain)を測定する(Step2)。

【0035】Step2で測定したジッター値jit (RtGain)と、Bestjitとを比較し(Step3)、jit(RtGain)が小さければ、Bestjit値をjit(RtGain)に代入すると共に、BestRtGainをRtGainの値として更新する(Step4)。さらに、RtGainの値をα分インクリメントする(Step5)。Step3で、jit(RtGain)がBestjit以上であれば、そのままStep5へ移行する。

【0036】Step5の後、RtGainの値とEndRtGainとを比較し(Step6)、RtGainの値がEndRtGain以下であれば、Step2へ移行し、過程を繰返す。

12 【0037】一方、RtGainの値がEndRtGa

inより大きければ、RtGainとして、BestRtGainの値を設定し(Step7)、一連の処理を終える。

【0038】続いて、本実施の形態3におけるチルト補正機構に対するチルト制御回路でのタンジェンシャルチルト制御信号のゲイン調整方法を、図9のフローチャートを使用して説明する。図9は図7のタンジェンシャル制御のゲイン調整フローチャートである。前提として、タンジェンシャルチルト制御の検索開始設定値をStartTtGain、最終設定値をEndTtGain、ステップを β 、ゲイン設定レジスタをTtGain、その設定におけるジッター値をjit(TtGain)、最良ジッター格納用変数としてBestTtGainと仮定する。

【0039】まず、初期化として、Bestjitに最大値(FFFFh)を入力し、BestTtGainをクリア(Oh)し、TtGainにStartTtGainを設定する(Step11)。次に、TtGainにおけるジッター値jit(TtGain)を測定する(Step12)。

【0040】このStep12で測定したジッター値jit (TtGain)と、Bestjitとを比較し (Step13)、jit (TtGain)が小さければ、Bestjit値をjit (TtGain)に代入すると共に、BestTtGainにTtGainの値を更新する(Step14)。さらに、TtGainの値を分分インクリメントする(Step15)。Step13で、jit (TtGain)がBestjitの値以上であれば、そのままStep15へ移行する。

【0041】Step15の後、TtGainとEnd TtGainとを比較し(Step16)、TtGainの値がEndTtGain以下であれば、Step12へ移行し、過程を繰返す。

【0042】一方、TtGainの値がEndTtGainより大きければ、TtGainとして、BestTtGain値を設定し(Step17)、一連の処理を終える。

40 【 0 0 4 3 】以上の各処理によって、ラジアルチルト制御信号並びにタンジェンシャルチルト制御信号の最適ゲインが決定され、最適ゲインに調整されたラジアルチルト制御信号がコイルA及びコイルBへの入力信号に加算されると共に、最適ゲインに調整されたタンジェンシャルチルト制御信号がコイルA及びコイルDへの入力信号に加算され、各コイルにおけるフォーカス方向の駆動力が適切に調整されることとなり、ラジアル方向及びタンジェンシャル方向のチルトに対して光ピックアップ2主要部を傾動させてチルトを解消でき、安定したデータ再50 生を行うことが可能となる。

駆動してシャフト26を動かすことで光ピックアップ2 タンジェンシャル方向に傾動させられる仕組みであ

14

【0044】(実施の形態4)本発明の実施の形態4に係る光ディスク装置について図10及び図11に基づいて説明する。図10は本発明の実施の形態4におけるチルト補正機構図、図11は本発明の実施の形態4におけるチルト補正のブロック図である。本実施の形態4におけるチルト補正のブロック図である。本実施の形態4に係る光ディスク装置は、実施の形態2におけるチルト制御回路12により制御するチルト補正機構として、図10に示すように、スピンドルモータ27近傍にラジアル方向と平行に配設され、スピンドルモータ27をラジアル方向に傾動させるラジアルチルト補正用モータ20と、スピンドルモータ27でタンジェンシャル方向に傾動させるタンジェンシャルチルト補正用モータ21とを備える構成である。

【0045】また、図11に示すように、チルト制御回路12から出力されるラジアルチルト制御信号(RtDRV)をラジアルチルト補正用モータ20の駆動信号として、タンジェンシャルチルト制御信号(TtDRV)をタンジェンシャルチルト補正用モータ21の駆動信号としてそれぞれ使用する。チルト制御回路におけるラジアルチルト制御信号及びタンジェンシャル制御信号のゲイン調整方法は、実施の形態3と同様であり、説明を省略する。

【0046】上記した本実施の形態4におけるチルト補正機構においては、最適ゲインに調整されたラジアルチルト制御信号がラジアルチルト補正用モータ20へ入力されると共に、最適ゲインに調整されたタンジェンシャルチルト制御信号がタンジェンシャルチルト補正用モータ21に入力され、ラジアルチルト補正用モータ20並びにタンジェンシャルチルト補正用モータ21が適切に駆動されることとなり、ラジアル方向及びタンジェンシャル方向のチルトに対してスピンドルモータ27及び光ディスク(図示を省略)を傾動させてチルトを解消でき、安定したデータ再生を行うことが可能となる。

【0047】(実施の形態5)本発明の実施の形態5に係る光ディスク装置について図12に基づいて説明する。図12は本発明の実施の形態5におけるチルト補正機構図である。本実施の形態5に係る光ディスク装置は、実施の形態2におけるチルト制御回路により制御するチルト補正機構として、図12に示すように、光ピックアップ2を光ディスク(図示を省略)の半径方向に案内する二つのシャフト25、26のうち一方のシャフト25端部に配設され、このシャフト25端部に配設され、このシャフト26を所定範囲内で平行移動させるタンジェンシャルチルト補正用モータ21とを備える構成である。ラジアルチルト補正用モータ20を駆動してシャフト25端部を動かすことで光ピックアップ2をラジアル方向に傾動させられます。タンジャンシャルチルト補正用モータ21を

【0048】また、第4の実施の形態と同様、図11に示すように、チルト制御回路から出力されるラジアルチルト制御信号(RtDRV)をラジアルチルト補正用モータ20駆動信号として、また、タンジェンシャルチルト制御信号(TtDRV)をタンジェンシャルチルト補正用モータ21駆動信号としてそれぞれ使用する。チルト制御回路におけるラジアルチルト制御信号及びタンジェンシャル制御信号のゲイン調整方法は、実施の形態3、4と同様であり、説明を省略する。

【0049】上記した本実施の形態5におけるチルト補正機構においては、最適ゲインに調整されたラジアルチルト制御信号がラジアルチルト補正用モータ20へ入力されると共に、最適ゲインに調整されたタンジェンシャルチルト制御信号がタンジェンシャルチルト補正用モータ20並びにタンジェンシャルチルト補正用モータ20並びにタンジェンシャルチルト補正用モータ21が適切に駆動されることとなり、ラジアル方向及びタンジェンシャル方向のチルトに対して光ピックアップ2を傾動させてチルトを解消でき、安定したデータ再生を行うことが可能となる。

【0050】(実施の形態6)本発明の実施の形態6に係る光ディスク装置について図13及び図14に基づいて説明する。図13は本発明の実施の形態6におけるチルト補正機構図、図14は本発明の実施の形態6におけるチルト補正機構図である。本実施の形態6に係る光ディスク装置は、実施の形態2におけるチルト制御回路により制御するチルト補正機構として、図13に示すように、光ピックアップ2内部におけるディテクタ3と対物レンズとの間に配設され、光ディスク1からのレーザ反射光の通過状態を調整するチルトキャンセル用液晶22を備える構成である。

【0051】このチルトキャンセル用液晶22は、図14に示すように、液晶がA、B、C、Dの四つの区域に分割されており、チルトにより発生した光の乱れを液晶によるシャッター機能を使うことにより、光を制御し、戻り光を補正することができる。分割されている四つの液晶のうち、ラジアル方向のチルトに伴ってレーザ反射光がずれ込む領域である液晶A、Bをラジアルチルト補正用液晶とすると共に、タンジェンシャル方向のチルトに伴ってレーザ反射光がずれ込む領域である液晶C、Dをタンジェンシャルチルト補正用液晶としている。

方のシャフト 2 6 端部に配設され、このシャフト 2 6 を 所定範囲内で平行移動させるタンジェンシャルチルト補 正用モータ 2 1 とを備える構成である。ラジアルチルト 補正用モータ 2 0 を駆動してシャフト 2 5 端部を動かす ことで光ピックアップ 2 をラジアル方向に傾動させら れ、また、タンジェンシャルチルト補正用モータ 2 1 を 2 1 を 2 2 に 2 3 に 2 3 に 2 3 に 2 3 に 2 3 に 2 3 に 2 3 に 2 3 に 2 3 に 2 3 に 2 4 に 2 4 に 2 4 に 2 4 に 2 4 に 2 5 に 2 4 に 2 4 に 2 5 に 2 4 に 2 5 に 2 4 に 2 5 に 2 5 に 2 5 に 2 6

する。チルト制御回路におけるラジアルチルト制御信号 及びタンジェンシャル制御信号のゲイン調整方法は、実 施の形態3、4、5と同様であり、説明を省略する。

【0053】上記した本実施の形態6におけるチルト補正機構においては、最適ゲインに調整されたラジアルチルト制御信号が液晶A、Bに入力されると共に、最適ゲインに調整されたタンジェンシャルチルト制御信号が液晶C、Dに入力され、液晶A、B並びに液晶C、Dが適切に制御されることとなり、ラジアル方向及びタンジェンシャル方向のチルトでずれたレーザ反射光に対して各10液晶領域での透過光量を調節してレーザ反射光のずれを補正し、ディテクタ3に反射光を正しく入射させてチルトによる影響を解消でき、面振れを有する光ディスクについても安定したデータ再生を行うことが可能となる。

【発明の効果】以上のように本発明によれば、光ディスクの面振れによるチルト量変化と一対一に対応して変化するフォーカス制御信号をチルト制御部に入力し、チルト制御部でフォーカス制御信号を基にチルト補正機構の作動制御を行うことで、チルト量に対応した補正を確実 20に行え、チルトを解消もしくはチルトの影響を回避でき、面振れを有する光ディスクに対してもジッターの発生を抑えて安定してデータ読出しを行えるという有利な効果を得られる。

【図面の簡単な説明】

【0054】

【図1】本発明の実施の形態1における光ディスク装置 のブロック図

【図2】図1の光ディスク装置のラジアル方向チルト発 生概念説明図

【図3】図1の光ディスク装置のタンジェンシャル方向 30 チルト発生概念説明図

【図4】本発明の実施の形態2におけるチルト制御ブロック図

【図5】図4のチルト角とチルト制御信号の関係説明図

【図6】本発明の実施の形態3におけるアクチュエータ の構成図

【図7】図6のフォーカスアクチュエータの駆動ブロッ ク図

【図8】図7のラジアルチルト制御のゲイン調整フロー

【図9】図7のタンジェンシャル制御のゲイン調整フロ

ーチャート

【図10】本発明の実施の形態4におけるチルト補正機 構図

16

【図11】本発明の実施の形態4におけるチルト補正の ブロック図

【図12】本発明の実施の形態 5 におけるチルト補正機 構図

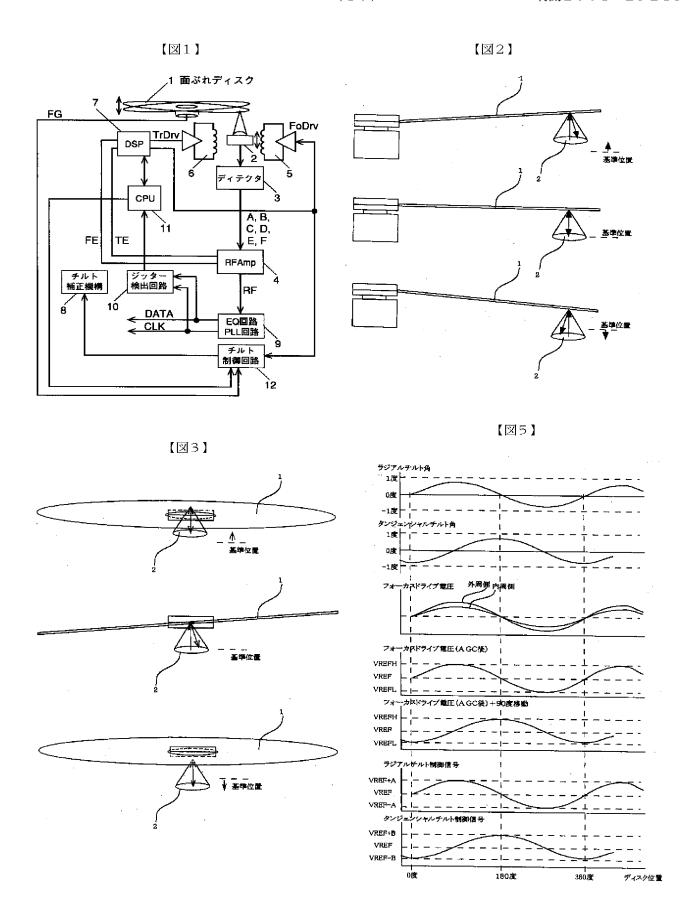
【図13】本発明の実施の形態6におけるチルト補正機 構図

10 【図14】本発明の実施の形態6におけるチルト補正機 構図

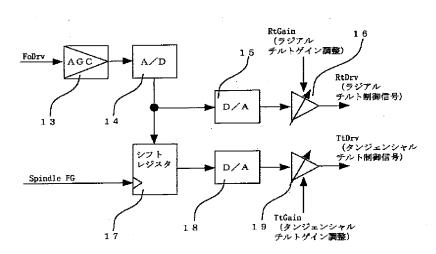
【図15】従来の光ディスク装置の構成図

【符号の説明】

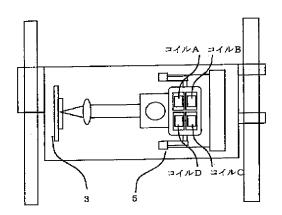
- 1 光ディスク
- 2 光ピックアップ
- 3 ディテクタ
- 4 RFアンプ
- 5 フォーカスアクチュエータ
- 6 トラッキングアクチュエータ
- 7 サーボプロセッサ
 - 8 チルト補正機構
 - 9 イコライザ及びPLL回路(EQ/PLL回路)
 - 10 ジッター検出回路
 - 11 CPU
 - 12 チルト制御回路
 - 13 オートゲインコントロール回路(AGC)
 - 14 A/D変換回路
 - 15 D/A変換回路
 - 16 バッファ回路
- 17 シフトレジスタ
 - 18 D/A変換回路
 - 19 バッファ回路
 - 20 ラジアルチルト補正用モータ
 - 21 タンジェンシャルチルト補正用モータ
 - 22 チルトキャンセル用液晶
 - 23 ラジアルチルト調整ねじ
 - 24 タンジェンシャルチルト調整ねじ
 - 25 シャフト
 - 26 シャフト
- 40 27 スピンドルモータ



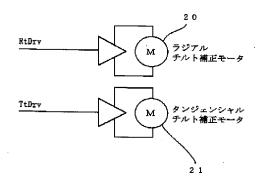
【図4】



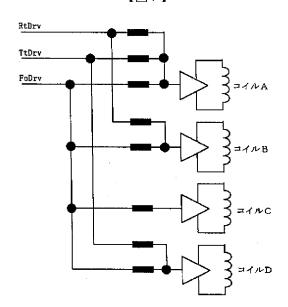
【図6】



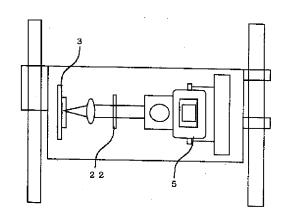
【図11】

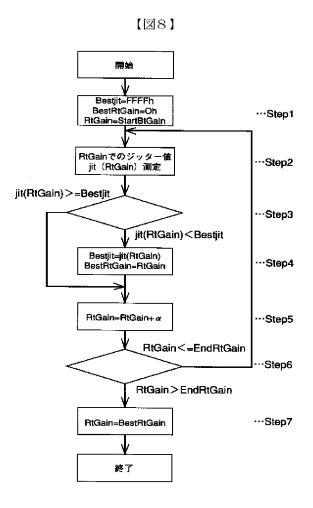


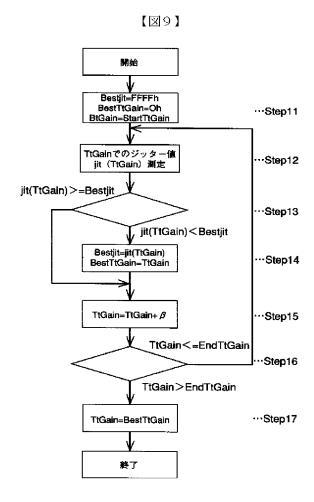
【図7】



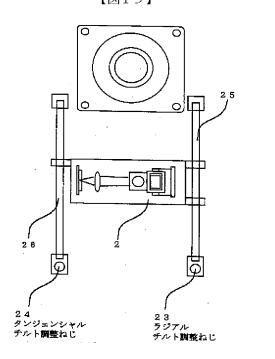
【図13】

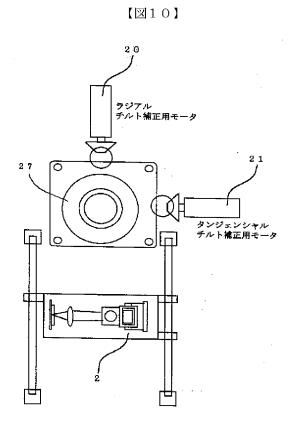


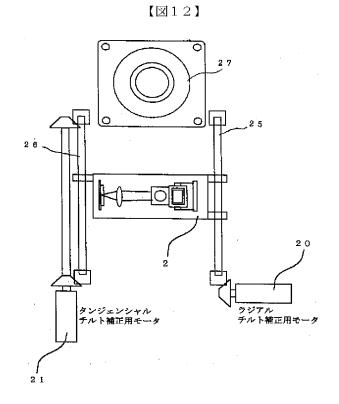




【図15】







【図14】

